

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 1 月 13 日 (13.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/003793 A1

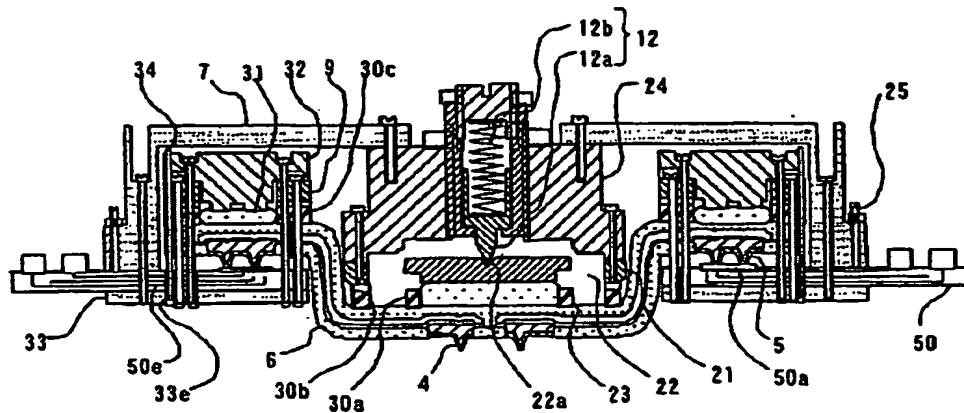
BEST AVAILABLE COPY

- (51) 国際特許分類: G01R 1/073
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009412
- (22) 国際出願日: 2004 年 7 月 2 日 (02.07.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-189949 2003 年 7 月 2 日 (02.07.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社日立製作所 (HITACHI, LTD.) [JP/JP]; 〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 春日部 進 (KA-SUKABE, Susumu) [JP/JP]; 〒2440817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 2 9 2 番地 株式会社日立製作所 生産技

- 術研究所内 Kanagawa (JP). 山本 武志 (YAMAMOTO, Takeshi) [JP/JP]; 〒2440817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 2 9 2 番地 株式会社日立製作所 生産技術研究所内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 浅村 皓, 外 (ASAMURA, Kiyoshi et al.); 〒1000004 東京都千代田区大手町 2 丁目 2 番 1 号 新大手町ビル 3 3 1 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, (続業者)

(54) Title: PROBE CARD AND SEMICONDUCTOR TESTING DEVICE USING PROBE SHEET OR PROBE CARD AND SEMICONDUCTOR DEVICE PRODUCING METHOD

(54) 発明の名称: プローブカード及びプローブシートまたはプローブカードを用いた半導体検査装置および半導体装置の製造方法



(57) Abstract: A probe card and a probe sheet used in a testing method (production method) for a semiconductor device using the same has a first contact terminal for electric contact with the electrode of a testing subject object of narrow pitch, a wiring extending from the first contact terminal, and a second contact terminal for electric contact with the wiring, wherein the first and second contact terminals are formed by using an etched hole in a member having crystallinity and are lined with a metal sheet.

(57) 要約: プローブカードおよびそれを用いた半導体装置の検査方法 (製造方法) に使用されるプローブシートは、狭ピッチに形成された検査対象物の電極と電気的に接触する第 1 の接触端子と、該第 1 の接触端子から引き回された配線と、該配線と電気的に接触する第 2 の接触端子を有し、第 1 と第 2 の接触端子は結晶性を有する部材のエッチング穴を用いて形成し、金属シートで裏打ちされている。

WO 2005/003793 A1